

[16013]

イオン注入法によるアルミニウム・チタン・シリコン窒化不定比化合物薄膜の
成長過程のその場観察

In-situ Observation of Growth Processes of non-stoichiometric compound, Aluminum, Titanium,
Silicon Nitride Thin Films due to Ion Implantation

学術論文（査読あり）

作成中